



2023年12月22日

各 位

会 社 名 SEMITEC 株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 石塚大助
(コード番号: 6626)
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 小 島 一 浩
(TEL. 03-3621-1155)

設備投資（薄膜サーミスタセンサ用）に関するお知らせ

当社独自の「薄膜サーミスタセンサ」への需要増加による増産対応の為、追加投資を行うことを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設備投資の目的

当社独自の薄膜サーミスタセンサは、応答性が速く、高耐熱な小型・薄型温度センサです。従前より、主にOA用途で使用されていましたが、医療用途、自動車用途向けの需要が年々高まっていることから、生産体制を強化するため追加の設備投資を決定いたしました。これにより、2027年3月期には現行(2023年11月末時点)の約2倍の生産能力となる予定です。

なお、本設備投資は、2022年7月8日付当社HPに掲載した「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金(2次公募) 交付決定に関するお知らせの件」とは別枠のものであります。

2. 設備投資の概要

(1) 設置事業所	千葉工場（千葉県千葉市花見川区天戸町）
(2) 投資内容	新規設備導入
(3) 投資総額	約20億円
(4) 資金調達の方法	自己資金
(5) 生産開始	2026年3月期から随時（予定）

3. 業績の見通し

本設備投資が2024年3月期の連結業績に与える影響はありません。なお、次年度以降の業績に与える影響につきましては必要に応じて開示してまいります。

以 上